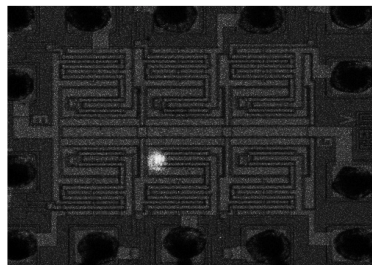
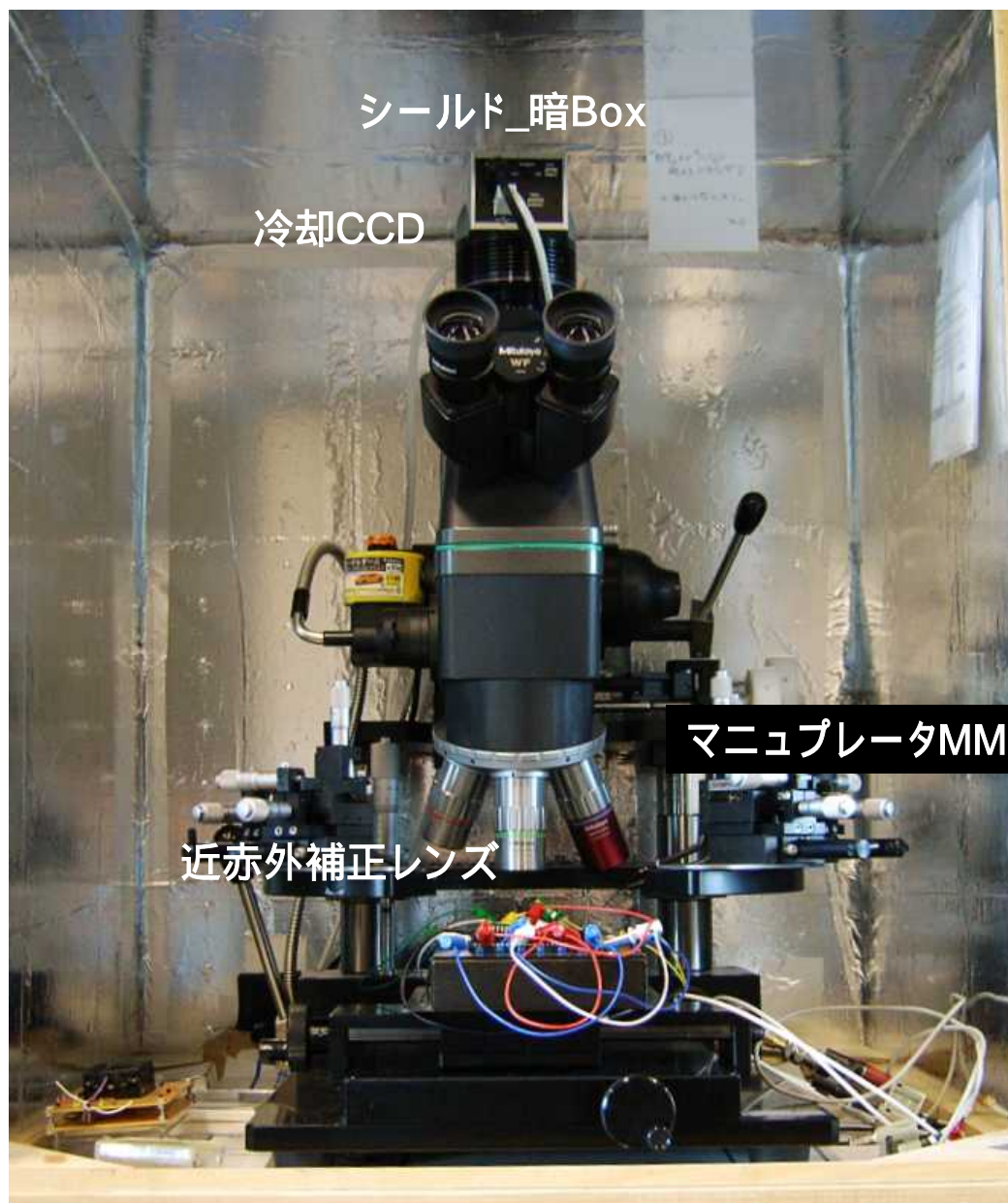


解析用マニュアルプローバ SE-1000/1100型



解析事例



シールド_暗Box

冷却CCD

マニプレータMM-6121/6122

近赤外補正レンズ

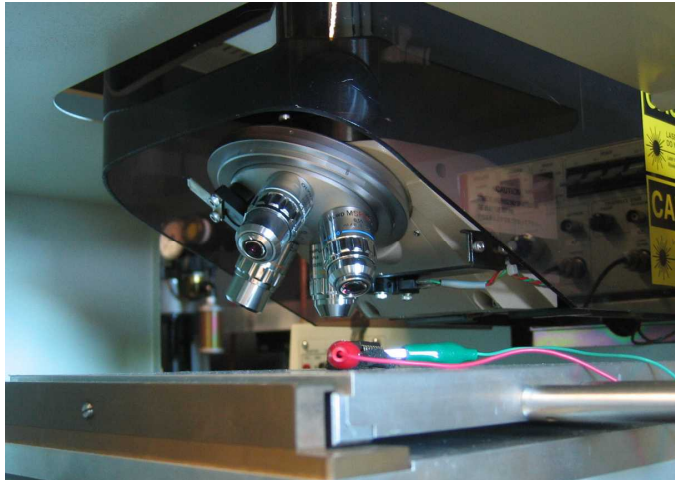
金属顕微鏡
デジタルカメラ装着
PC上への画像取得機能つき



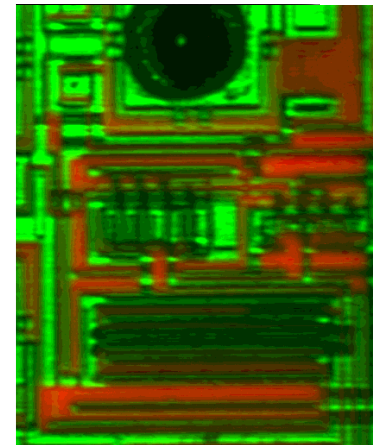
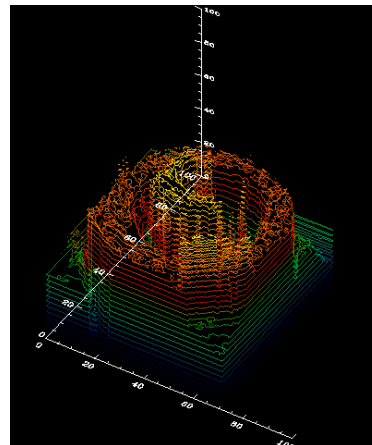
プロービング装置
改造中



レーザー顕微鏡 OBIC検出機能付き (JEOL-6602)



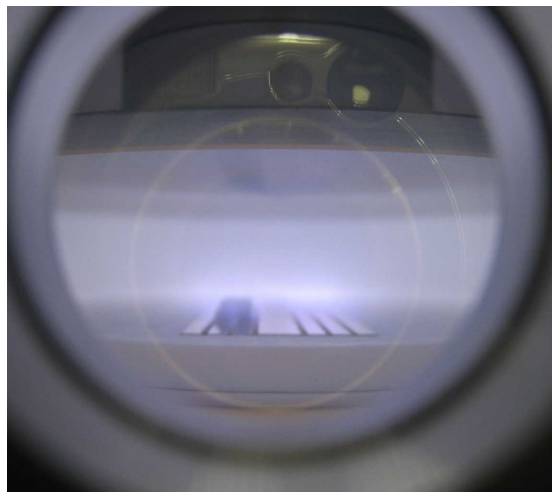
3次元画像
(PAD部)



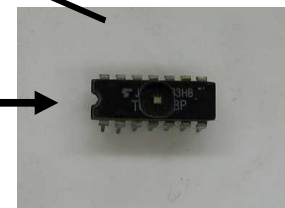
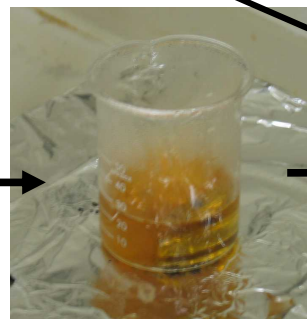
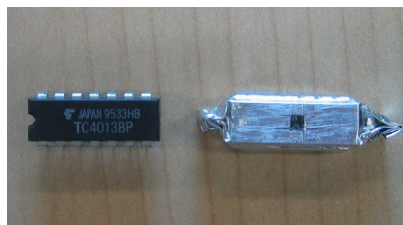
緑: LSIパターン像
赤: OBIC像
の組合せ

RIE装置 (Reactive Ion Etching) NSC

ICプロセス室(A151)



処理室(A251)

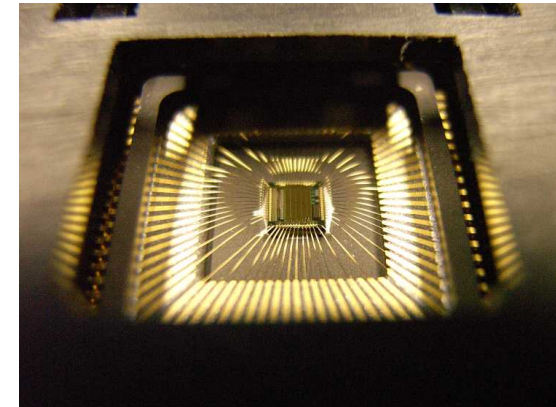
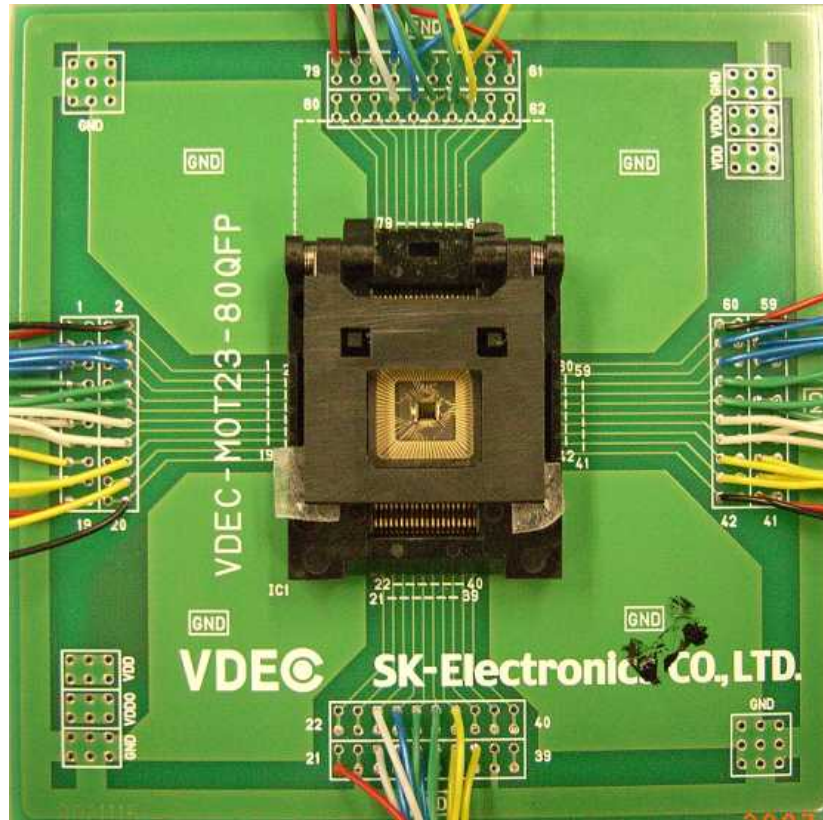


ESD試験機(3種類のESDモデル装着可能)



VDEC利用：物理解析用サンプル作成-1-

VDEC利用による故障箇所作り込みサンプルの作成(0.35 μm ルール)

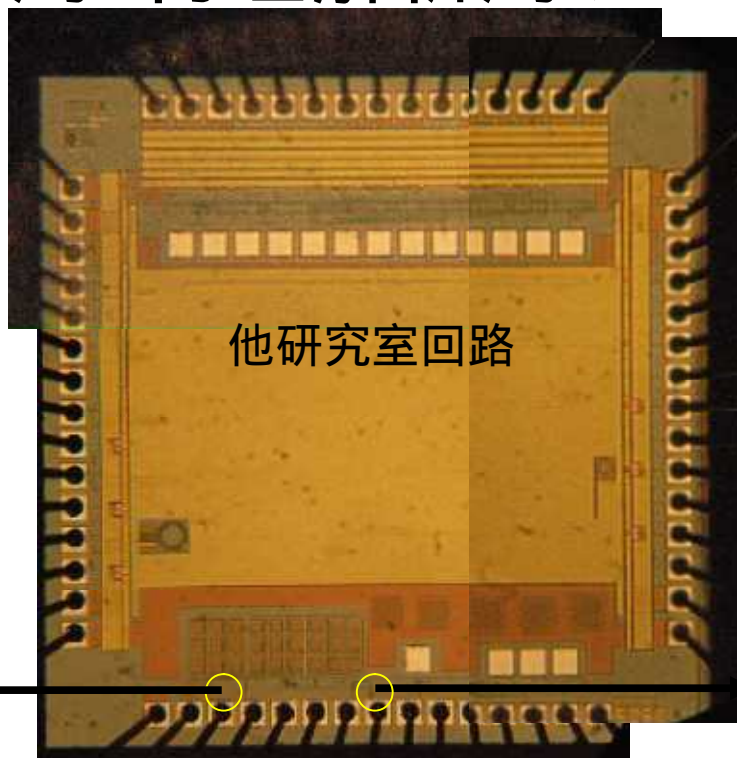
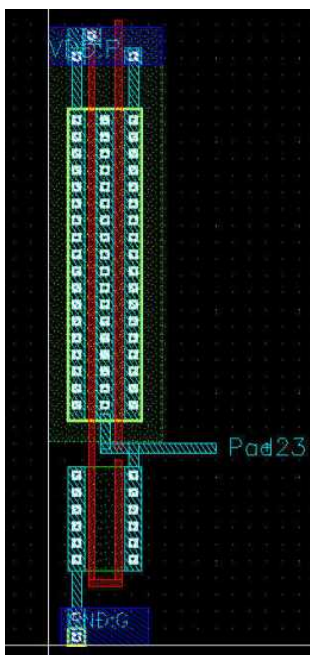


発光、OBIC解析

第二回目の設計：(0.18 μm)回路検討中

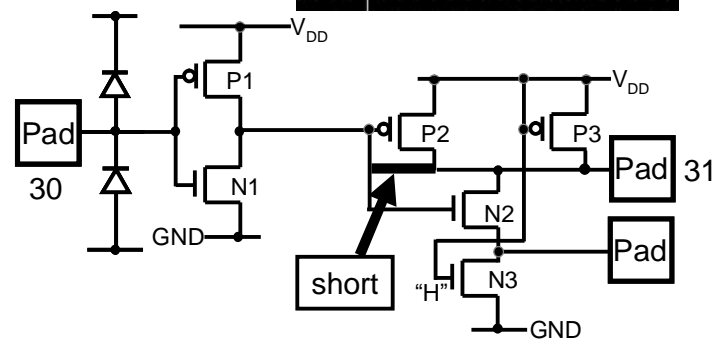
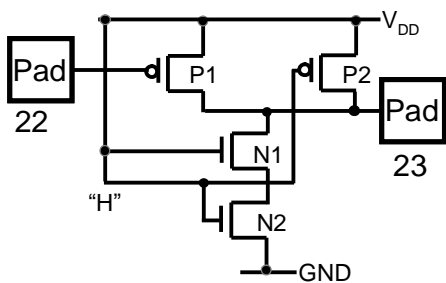
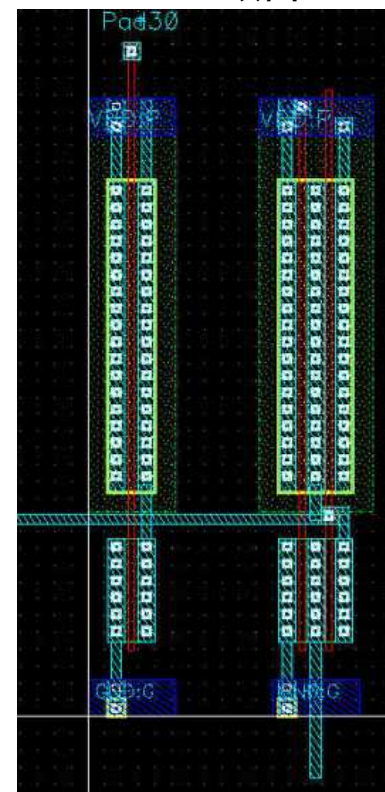
VDEC利用:物理解析用サンプル作成-2-

Open故障



TEGパターン作成
(10種類の故障パターン)

Short故障



VDEC利用:物理解析用サンプル作成-2-

